

等离子清洗机

Gas Plasma Dry Cleaners | RIE · DP模式、平行平板电极

PDC200/210/510

Made in Japan

高频输出 300W (PDC200型) / 500W (PDC210/510型)

电极尺寸 250×170mm (PDC200/210型) / 410×170mm (PDC510型)

适用于研究开发的小型等离子清洗机。



使用等离子体的表面处理装置。着重于“使用简单”的台式高性能型号，调取数据简单，以电子材料为中心，可对应多种用途。

用途

- CSP、BGA、COB基板的等离子清洗
- 去除有机膜和金属氧化膜
- 印刷电路板的干式清洗
- 界面活性处理
- LED封装

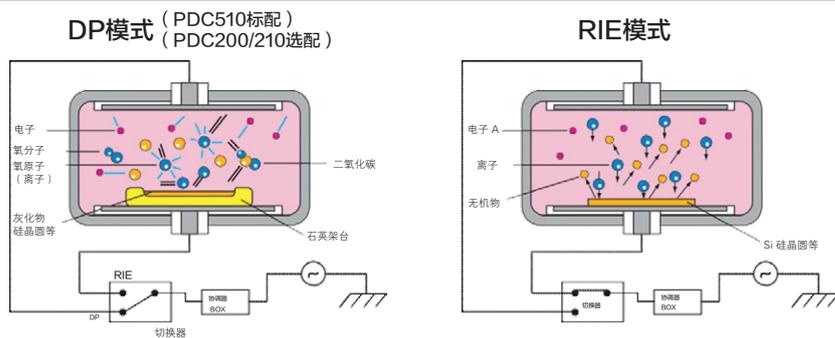
特征

- DP模式 (PDC510标配 · PDC200/210选配)
- RIE模式
- 均匀性高的电极构造
- 操作简单的触摸屏控制器

内槽



构成图



规格

型号	PDC200	PDC210	PDC510
等离子模式	RIE (DP模式选配)		RIE/DP
电极构造	平行平板 (固定)		
高频输出	Max300W	Max500W	
频率	13.56MHz		
控制·显示	液晶触摸屏		
反应室尺寸	W400×D250×H150mm		W500×D300×H200mm
电极尺寸	W250×D170mm		W400×D200mm
反应室材质	铝		
反应气体	2系统 (Ar、O ₂)		
填充气体	N ₂ 或干燥空气		
反应气体流量控制	流量计	聚合控制器	
真空泵	另行选配	油泵 (约345L/分) 标配	油泵 (约500L/分) 标配
气体导入口	反应气体2个、填充气体1个		
外形尺寸	W540×D600×H600mm	W540×D600×H600mm	W700×D700×H1285mm
重量	约100kg	约105kg	约180kg
电源	单相 AC100V 10A	三相AC200V 6A	三相AC200V 8A

1 灭菌器

2 喷雾干燥器

3 马弗炉

4 恒温箱干燥箱

5 恒温培养箱

6 等离子装置

7 纯水制造装置

8 恒温水槽

9 恒温水循环

10 旋转蒸发器

11 冷冻干燥冷阱

12 搅拌器振荡器

13 清洗机

14 选购品

等离子清洗机

Gas Plasma Dry Cleaners | RIE · DP模式、多段平行平板电极

PDC610

Made in Japan

最高输出 600W

电极尺寸 $\phi 215 \times 305\text{mm}$

小型、多段式等离子清洗机。

用途

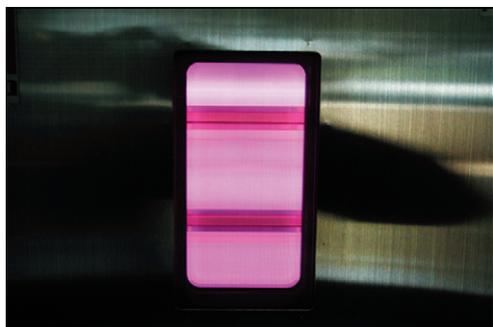
- 提高各种材料的粘接性、表面改质处理
- 灰化、蚀刻处理
- 塑料封装前处理
- 印刷基板镀层前处理
- LED关联部品处理
- 电子部品清洗
- 光刻胶剥离或表面残留物去除
- 光学、金属、机械部品等精密部件的清洗
- 包含氟化树脂的树脂类产品表面改质
- FCC对应

特征

- 600W的小型高输出功率
- 电极可选择1·2·3段（采购时指定）
- 可处理纵型的试料收纳盒
- 可选择RIE/DP模式（采购时指定）
- 数据记录器（选配）
- 适配点记忆功能（选配）



等离子放电



内槽



规格

型号	PDC610
等离子模式	RIE/DP（固定模式）
电极构造	3段独立平行平板（固定）
高频输出	Max600W
频率	13.56MHz
控制·显示方式	PLC·触摸屏
反应腔尺寸	W350×D270×H300mm
反应腔材质	A5052
反应气体	2系统（Ar、O ₂ ）
填充气体	N ₂ 或干燥空气
真空泵	油泵（约345L/分）·标配
外形尺寸	W600×D722×H700mm
外装材质	不锈钢
电源	3相 AC200 50/60Hz 15A

灭菌器 1

喷雾干燥器 2

马弗炉 3

恒温箱干燥箱 4

恒温培养箱 5

等离子装置 6

纯水制造装置 7

恒温水槽 8

恒温水循环 9

旋转蒸发器 10

冷冻干燥冷阱 11

搅拌器振荡器 12

清洗机 13

选购品 14